राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर

अभिषद की अनुशंसा पर

रुपम गोस्वामी

पंजीकरण संख्या १४-३-०४-१०३

को

'गेट अभियांत्रिक और ऊर्जा-अंतराल अभियांत्रित टी-फेटः अनुरुपण, प्रतिरुपण और प्रयोग'

में

अनुसंधान कार्य की मान्यता पर

विद्या-वाचस्पति

की उपाधि प्रदान करता है ।

भारतीय गणराज्य के अंतर्गत सिलचर में आज २३ जून २०१८ को संस्थान की यह मुद्रा अंकित उपाधि दी गई ।

National Institute of Technology Silchar

upon the recommendation of the Senate hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

on

Rupam Goswami

Registration No. 14-3-04-103

in recognition of the research work on

'Gate Engineered and Bandgap Engineered TFETs: simulation, modeling and applications'

This certificate is issued this day, the 23rd June, 2018, under the seal of the Institute at Silchar in the Republic of India.

निदेशक एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद
Director and Chairman, Senate

कुलसचिव
Registrar

अध्यक्ष, शासी मंडल
Chairperson, Board of Governors

Rupam Goswami